

受託成膜サービス

当社ではお客様の研究・開発をサポートするため、ターゲット製作に加え、お客様のご要望に合わせスパッタリングによる受託成膜サービスを承っております。

<当社受託成膜の強み>

- ・ご希望の組成に合わせたターゲットの製作が可能
- ・ターゲット製作の技術・経験を活かし、幅広い材料の成膜が可能
- ・ターゲットの在庫が豊富（金属・酸化物・その他複合物等）
- ・あらゆるサイズ・材質の基板をまとめて一度に成膜することが可能
- ・試作成膜用の小型装置を用いる事により低コストを実現
- ・ターゲット製作～成膜迄を一貫した対応が可能のため、短納期対応が可能
- ・必要に応じて成膜用治具等の製作も可能

<成膜装置ご紹介>

お客様のご要望・用途に合わせて、下記の装置をお選び頂けます。



スパッタ方式：
マグネトロンスパッタ
(スパッタダウン)

電源：DC/RF

カソード数：3源

使用ガス：Ar・O₂・N₂

ステージ加熱：
可(MAX600℃)

対応基板サイズ：
□30mm 8枚 など
※□30以上の場合はご相談下さい

逆スパッタ：可

T-S距離：50~90mm

スパッタ方式：
マグネトロンスパッタ
(スパッタダウン)

電源：RF

カソード数：1源

使用ガス：Ar・O₂・N₂

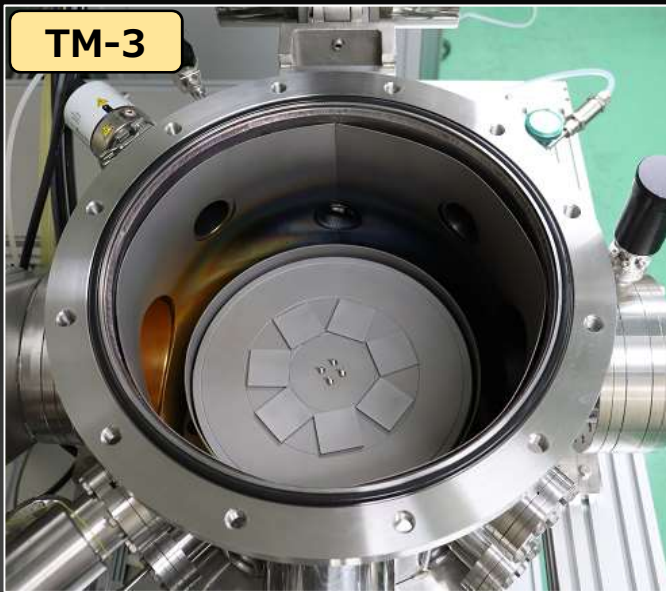
ステージ加熱：不可

対応基板サイズ：
□30mm 14枚
□50mm 7枚 など

逆スパッタ：不可

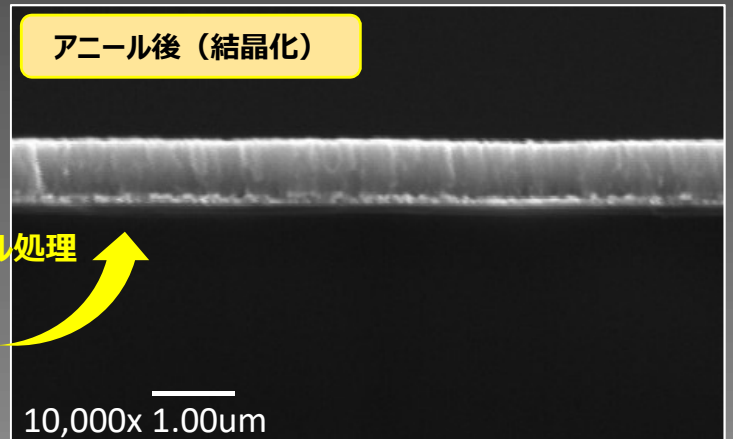
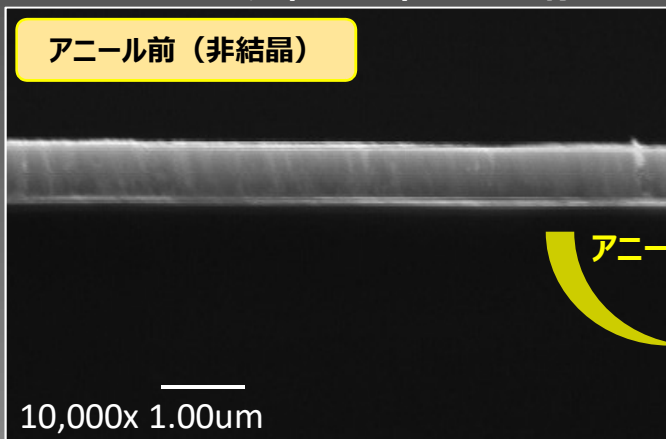
T-S距離：50mm(固定)

<装置内基板設置イメージ>



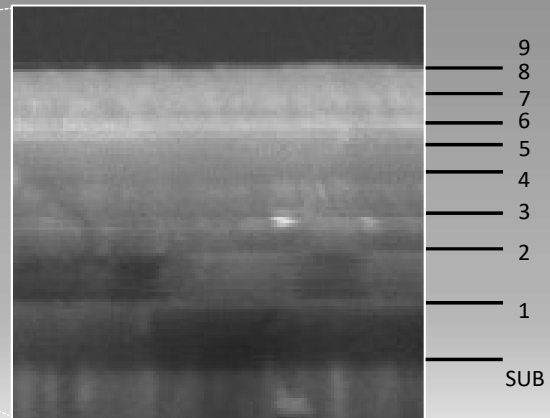
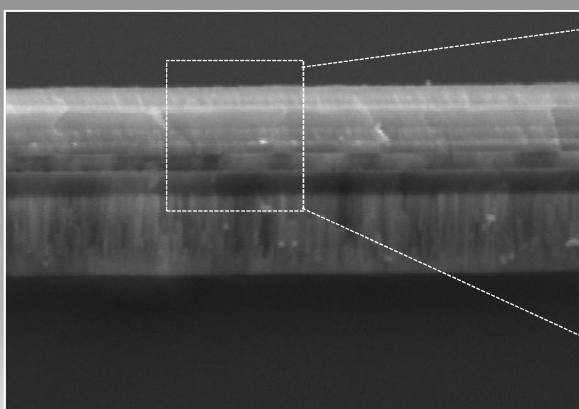
<実績紹介>

・LiCoO₂膜 非結晶→結晶化の様子



・9層積層成膜

(酸化物A/酸化物B/酸化物C/酸化物A/酸化物B/酸化物C/酸化物A/酸化物B/酸化物C//SUB)



この他にも多数実績がございます。是非お気軽にお問い合わせください。

TOSHIMA Manufacturing Co., Ltd.
Materials system division

株式会社 豊島製作所 マテリアルズシステム事業部
〒355-0036 埼玉県東松山市下野本1414
TEL:0493-24-6774
URL:<http://www.material-sys.com>